PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-074765

(43)Date of publication of application: 15.03.2002

(51)Int.CI.

G11B 7/26 C25D 1/10

(21)Application number: 2000-259141

.

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

29.08.2000

(72)Inventor: FURUYA NOBORU

(54) STAMPER FOR OPTICAL DISK AND METHOD OF MANUFACTURING FOR THE SAME AND OPTICAL DISK MANUFACTURING METHOD

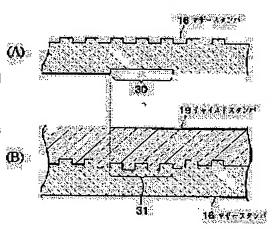
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a method of forming the level differences of arbitrary patterns, such as pictures or characters, on the data bit-forming surface of an optical axis at a low cost.

SOLUTION: When an electroforming process is carried out by using a mother stamper (16) of a thin film which has the data bit-forming surface on its front surface and has recessed parts (30) of the arbitrary patterns, such as the pictures or characters, on its rear surface.

has the data bit—forming surface on its front surface and has recessed parts (30) of the arbitrary patterns, such as the pictures or characters, on its rear surface, recessed parts (30) are flattened and the recessed parts are formed on the data bit—forming surface. These recessed parts are reverse transferred to the data bit—forming surface of a child stamper (19). A replica transferred with the patterns described above on the data bit—forming surface is obtained when the replica is injection molded by using such child stamper (19). If a reflection layer and protective layer are formed on this replica, the optical disk formed with the level differences of the arbitrary patterns, such as the pictures or

characters, on the data bit-forming surface may be manufactured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-74765 (P2002-74765A)

(43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FI.		テーマコート*(参考)
G11B	7/26	511	G11B 7/26	511	5D121
C 2 5 D	1/10		C 2 5 D 1/10		

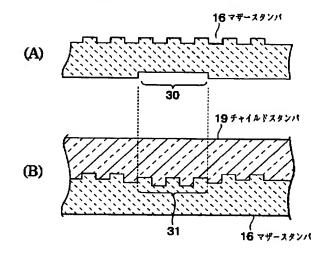
	審査請求	未簡求	請求項の数 5	OL	(全	5 頁)
特願2000-259141(P2000-259141)	(71)出顧人			·		
平成12年8月29日(2000.8.29)	セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (72)発明者 古谷 昇					
	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイ: ーエプソン株式会社内					
	(74)代理人			(51·2·1	3)	
	Fターム(参考) 5D121 CA03 CB03 CB07 DD07					
		特願2000-259141(P2000-259141) (71)出願人 平成12年8月29日(2000.8.29) (72)発明者	特願2000-259141(P2000-259141) (71)出願人 0000023 セイコー 平成12年8月29日(2000.8.29) 東京都線 (72)発明者 古谷 身 長野県間 ーエプ: (74)代理人 1000791 弁理士	特願2000-259141(P2000-259141) (71)出願人 000002369 セイコーエプソン株式: 東京都新宿区西新宿 2 で (72)発明者 古谷 昇 長野県諏訪市大和 3 丁 ーエプソン株式会社内 (74)代理人 100079108 弁理士 稲葉 良幸	特願2000-259141(P2000-259141) (71)出願人 000002369 セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4者 (72)発明者 古谷 昇 長野県諏訪市大和3丁目3番9 ーエプソン株式会社内 (74)代理人 100079108 弁理士 稲葉 良幸 (外2名	セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (72)発明者 古谷 昇 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 ーエプソン株式会社内 (74)代理人 100079108 井理士 稲葉 良幸 (外2名)

(54) 【発明の名称】 光ディスク用スタンパとその製造方法並びに光ディスク製造方法

(57)【要約】

【課題】 光ディスクのデータピット形成面に絵又は文字等の任意のパターンの段差を形成する方法を低コストで実現する。

【解決手段】 表面にデータピット形成面を有し、裏面に絵又は文字等の任意のパターンの凹部 (30)を有する薄膜のマザースタンパ (16)を用いて電鋳処理すると、凹部 (30)が平坦化され、データピット形成面に凹部が形成される。この凹部がチャイルドスタンパ (19)のデータピット形成面に逆転写される。このチャイルドスタンパ (19)を用いてレプリカを射出成型すると、データピット形成面に前記パターンが転写されたレプリカが得られる。このレプリカに反射層及び保護層を成膜すれば、データピット形成面に絵又は文字等の任意のパターンの段差が形成された光ディスクを製造することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 データピット形成面に絵又は文字等の任 意のパターンの段差が形成されている光ディスク用スタ ンパ。

【請求項2】 表面にデータピットを有し、裏面に絵又 は文字等の任意のパターンの段差を有する薄膜の鋳型を 用いて電鋳処理することで、前記データピットと前記段 差を同一面内に転写形成し、データピット形成面に前記 パターンの段差が形成された光ディスク用スタンパを製 造する方法。

レーザマーカを用いて前記鋳型に凹部の 【請求項3】 段差を形成する請求項2に記載の光ディスク用スタンパ 似 告 方 法。

【請求項4】 印刷法を用いて前記鋳型に凸部の段差を 形成する請求項2に記載の光ディスク用スタンパ製造方

【請求項5】 データピット形成面に絵又は文字等の任 意のパターンの段差が形成されている光ディスク用スタ ンパを用いて、樹脂を成型し、光ディスクのデータピッ ト形成面に上記パターンの段差を転写形成する光ディス 20 ク製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はコンパクトディスク (CD)、レーザディスク (LD)、光磁気ディスク (MO)、ミニディスク (MD) などの再生専用光ディ スク或いは記録再生用光ディスクのデータピット形成面 に絵又は文字等の任意のパターンの段差を設ける製造技 術に関する。

[0002]

【従来の技術】特開平8-55370号にはスタンパの データピット形成面の裏面、又はスタンパを取り付ける 射出成型装置のスタンパ取付鏡面部に絵又は文字等の任 意のパターンの段差を設けることで、レプリカを成型す るための溶融樹脂を高圧で注入したときに、スタンパが 前記段差の部分で変形し、このスタンパの変形がレプリ カに転写されてデータピット形成面にパターンを転写す る技術が開示されている。

[0003]

術のようにスタンパのデータピット形成面の裏面に絵又 は文字等の任意のパターンの段差を設けると、レプリカ 成型の都度にスタンパ取付鏡面部との接触によってスタ ンパの変形が繰り返されるため、レプリカの寿命が短く なるという問題があった。

【0004】また、スタンパを取り付ける射出成型装置 のスタンパ取付鏡面部は高価な成型機であるため、前記 鏡面部に絵又は文字等の任意のパターンの段差を設ける と、光ディスクの製造コストが高くなるという問題があ る。

【0005】さらに、上記の従来技術ではスタンパのデ ータピット形成面の裏面、或いは射出成型装置のスタン パ取付鏡面部にエッチング技術を利用して絵又は文字等 の任意のパターンの段差を設けているが、この方法での パターン形成は技術的に困難である。

【0006】そこで、本発明は光ディスクのデータピッ ト形成面に絵又は文字等の任意のパターンの段差を形成 する方法を低コストで実現する方法、及び光ディスクの データピット形成面に前記段差を設けるためのスタンパ 10 とその製造方法を提供することを課題とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するべ く、本発明では光ディスク用スタンパのデータピット形 成面に絵又は文字等の任意のパターンの段差(凹部又は 凸部)を形成する。かかる構成によれば、スタンパの裏 面には前記段差を形成しなくてよいため、スタンパとス タンパ取付鏡面部は常に平面的に接触する。従って、レ プリカ成型の都度にスタンパ取付鏡面部との接触によっ てスタンパの変形が繰り返されることがなく、スタンパ の寿命が短くなるという従来の問題を解消できる。

【0008】このような光ディスク用スタンパを製造す るには、表面にデータピットを有し、裏面に絵又は文字 等の任意のパターンの段差を有する薄膜の鋳型を用いて 電鋳処理することで、前記データピットと前記段差を同 一面内に転写形成し、光ディスク用スタンパのデータピ ット形成面に前記パターンの段差を形成すればよい。

【0009】鋳型に形成される段差として、レーザマー カを用いて凹部を形成してもよく、印刷法を用いて凸部 を形成してもよい。また、上記の光ディスク用スタンパ 30 を用いれば、樹脂を成型し、光ディスクのデータピット 形成面に上記段差を転写形成することで、データピット 形成面に上記段差を有する光ディスクを製造することが できる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、各図を参照して本実施の形 態について説明する。

【0011】図1及び図2は光ディスク用スタンパ及び 光ディスクの製造工程断面図である。

【0012】まず、図1(A)に示すように、表面が研 【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の従来技 40 磨され、十分な平面度を有するガラス原盤10上にフォ トレジストを 0. 1 μ m程度に回転塗布し、フォトレジ スト層11を形成する。そして、ホットプレート上にガ ラス原盤10を設置してフォトレジスト層11の残留溶 媒を除去し、プリベーキング処理を行う。

> 【0013】次に、同図(B)に示すように、光ディス クに記録する音楽信号に対応して、He-Cdレーザ1 2を変調し、集光レンズ13でフォトレジスト層11上 にレーザスポットを形成し、同心円状或いはスパイラル 状のトラックに沿ってピットパターンの露光を行う。

50 【0014】続いて、ガラス原盤10を現像装置に設置

し、回転させながらアルカリ現像液を塗布し、回折光を モニタしながら同図 (C) に示すように、露光された部 分のフォトレジスト層 1 1 を溶解除去する。規定の回折 強度が得られた時点で現像を停止し、洗浄液で洗浄し、 ポストベーキング処理して乾燥させる。

【0015】次に、同図(D)に示すように、ポストベーキング処理したガラス原盤10のフォトレジスト層11の表面にスパッタリング法、或いは無電解メッキ法によりニッケル導電膜14を成膜し、続いてニッケル層の電鋳を行ってマスタースタンパ15を形成する。電鋳後、ガラス原盤10からマスタースタンパ15を剥離し、残留しているフォトレジスト層11を除去する。

【0016】今度はこのマスタースタンパ15に酸化処理を行い、図2(F)に示すように、マスタースタンパ15を鋳型として、電鋳処理によりマスタースタンパ15の溝形状を逆転写したマザースタンパ16を形成する。このマザースタンパ16が請求項2の「薄膜の鋳型」に該当する。

【0017】続いて、同図(G)に示すように、レーザマーカを用いてマザースタンパ16のデータピット形成20面の裏面に絵又は文字等の任意のパターンを有する段差(凹部)を形成する。この工程では、マザースタンパ16の裏面にレーザマーカからのビーム17を集光レンズ18によって集光し、絵又は文字等の任意のパターンを直接描画して刻印することで凹部を形成する。図4

(A) の符号 3 0 は当該凹部の拡大図であり、その深さは数 μ m程度である。マザースタンパ 1 6 に形成する絵又は文字等の任意のパターンの例として、例えば、図 3 に示すように、アルファベットの「A」及び「B」の文字などがある。

【0018】以上の工程を経てマザースタンパ16が形成されるが、このマザースタンパ16に酸化処理を行い、図2(H)に示すように、マザースタンパ16を鋳型として、マザースタンパ16の溝形状を逆転写したチャイルドスタンパ19を形成する。図4(B)は図2(H)の符号27で示した点線部分の拡大図である。マザースタンパ16は薄膜の鋳型であるため、同図に示すように、そのデータピット形成面の裏面に形成されていた凹部30はチャイルドスタンパ19の電鋳処理の際に平坦化され、データピット形成面に凹部が形成される。従って、チャイルドスタンパ19のデータピット形成面には当該凹部を逆転写した凸部31が形成される。

【0019】以上の工程を経てデータピット形成面に絵又は文字等の任意のパターンを有する凸部31が形成されたチャイルドスタンパ19を得ることができる。このチャイルドスタンパ19が請求項1の「光ディスク用スタンパ」に該当する。続いて、チャイルドスタンパ19の裏面を研磨し、プレスにて内外径を抜き取り、同図(1)に示すように、射出成型装置24のスタンパ取付

(I)に示すように、射出成型装置24のスタンパ取付 鏡面部21にチャイルドスタンパ19の裏面が接するよ 50

【0020】続いて、同図(J)に示すように、レプリカ20のデータピット形成面にスパッタリング法により、アルミニウムの反射層25を成膜し、さらにその上に紫外線硬化樹脂の保護層26を成膜する。以上の製造工程を経て光ディスクを得る。図6は図2(J)の符号29で示した点線部分の拡大図である。同図に示すように、レプリカ20のデータピット形成面にはチャイルドスタンパ19の凸部31のパターンが転写された凹部32が形成されている。この凹部32の段差によって、外観目視により、絵又は文字等の任意のパターンを読み取ることができる。

D 【0021】尚、上記の説明ではマザースタンパ16に レーザマーカを用いて絵又は文字等の任意のパターンを 有する凹部30を形成したが、印刷法を用いて高さ数μ m程度の任意のパターンの凸部を形成してもよい。ま た、レプリカ20の成型は射出成型に限らず、2P法 (photo polymarization method) でもよい。

【0022】以上、説明したように、本実施の形態によれば、チャイルドスタンパ19のデータピット形成面に絵又は文字等の任意のパターンを有する段差を形成し、チャイルドスタンパ19の裏面には段差を形成しないた30 め、チャイルドスタンパ19とスタンパ取付鏡面部21は常に平面的に接触する。従って、レプリカの射出成型の都度にスタンパ取付鏡面部との接触によってチャイルドスタンパ19の変形が繰り返されることがなく、スタンパの寿命が短くなるという従来の問題を解消できる。

【0023】また、本実施の形態によれば、スタンパ取付鏡面部21に絵又は文字等の任意のパターンを有する段差を形成する必要がないため、光ディスクの製造コストを下げることができる。また、マザースタンパ16に形成する絵又は文字等の任意のパターンを有する段差はレーザマーカや印刷法等の簡易な方法で形成できるため、光ディスクのデータピット形成面に絵又は文字等の任意のパターンを簡易に形成できる。

[0024]

【発明の効果】本発明によれば、光ディスクのデータピット形成面に絵又は文字等の任意のパターンの段差を簡 易且つ低コストで形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】光ディスク用スタンパ及び光ディスクの製造工 程断面図である。

50 【図2】光ディスク用スタンパ及び光ディスクの製造工

程断面図である。

【図3】マザースタンパに形成するパターンの例であ る。

【図4】マザースタンパとチャイルドスタンパの部分拡 大図である。

【図5】チャイルドスタンパとレプリカの部分拡大図で ある。

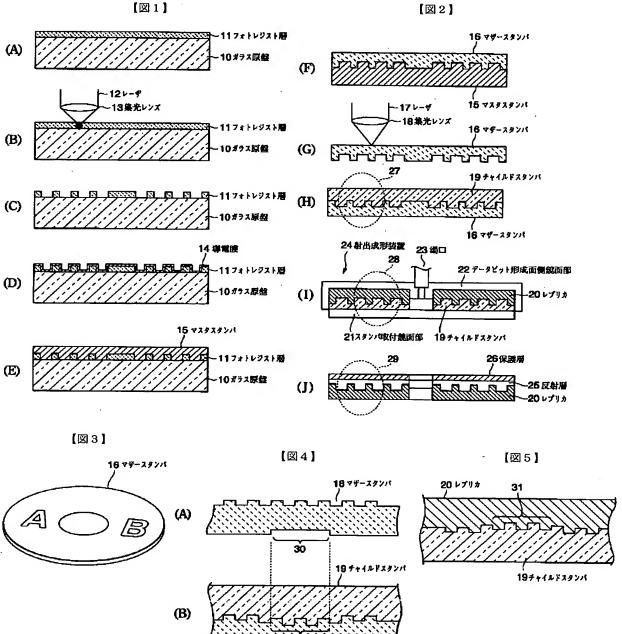
【図6】光ディスクの部分拡大図である。

【符号の説明】

10…ガラス原盤、11…フォトレジスト層、12…レ ーザ、13…集光レンズ、14…導電膜、15…マスタ ースタンパ、16…マザースタンパ、17…結像レン ズ、18…レーザ、19…チャイルドスタンパ、20… レプリカ、21…スタンパ取付鏡面部、22…データピ ット形成面側鏡面部、23…湯口、24…射出成型装 置、25…反射層、26…保護層

6

【図2】



16 マザースタンパ

e Sate was to especial

【図6】

